

OpticStudio 16.5 SP5 版本說明

OpticStudio™ 16.5

16-June-17

Service Pack 5: Release Notes

OpticStudio 16.5 Service Pack 5 包含以下修正與改進。

序列式表面以及光線追跡

機構半徑 – 在一些有 Coordinate Break 的系統中，機構半徑可能出現的計算問題已經修正。

光線瞄準 – 對於光欄顯著離軸的系統，現在光線瞄準演算法已經改進。

Q-Type 非球面 – 追跡 Q-Type 的演算法已經加強，以應對表面斜率比較陡峭的狀況。

加入鏡面工具 – 在包含 Q-Type 以及多重組態的系統中使用加入鏡面工具的問題已經解決。

鏡面基座 – 當一個鏡面的機構半徑大於光學孔徑時，模擬其背面可能產生的問題已經解決。

序列式分析與計算

Through Focus FFT MTF – 此工具的效能已經加強，在一些狀況下可以到兩倍快。

檔案轉換 – 轉換 F3D 到 ZBF 的工具現在加入一個選項，讓使用者可以決定是否要跳過高斯光束擬合的部分。

光束檔檢視器 – 在光束檔檢視器中加入一個選項，讓使用者可以改變 ZBF 檔的投影角度。這個功能類似於 POP 中的 Projection。

光束檔檢視器 – 此工具的秀圖速度已經加快。

非序列物件與光線追跡

Faceted Surface 物件 – 這個非序列物件的一個問題已經解決，當外型是環狀面 (Toroidal) 時，現在 X Half Width 已經可以正確計算。

Source Diode 物件 – 此光源物件已經加強，現在可以對應到更大角度的模擬。

布林 (Boolean) 物件 – 當布林的對象包含 Biconic Zernike Lens 的時候，現在布林物件的精度已經提升。

物件編輯器 (Object Editor) – 物件編輯器中的樹狀清單已經改進，現在文字更容易閱讀了。

程式編寫

ZOS-API – 介面 IAS_PathAnalysis 界面現在已開放給 COM 連結 (例如 C++ 或 Python)。

資料庫

Edmund Optics 鍍膜 – 新增 Edmund Optics 的鍍膜，目前該資料庫有 6218 個鏡片。

DIAS 紅外鏡片目錄 – 新加入 106 個鏡片，現在此目錄共有 173 個鏡片。

OHARA 材料庫 – 一個新的 Preferred 玻璃 S-TIH57，已經加入到此目錄中。

HOYA 材料庫 – 新增四個新玻璃材料，目前總共有 386 個玻璃。

Applied 原器清單 – 此清單以更新，現在包含有 892 個原器。

Lightning 原器清單 – 此清單因為已經過時故移除。